## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02-021550

(43) Date of publication of application: 24.01.1990

(51)Int.CI.

H01J 37/22

(21)Application number: 63-172248

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

(22)Date of filing:

11.07.1988

(72)Inventor: OSUGA SHINJI

**SUGIYAMA MASARU** 

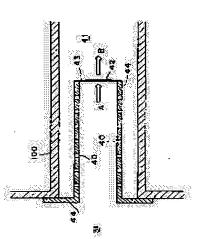
OBA AKIRA

KINOSHITA KATSUYUKI

### (54) X-RAY IMAGE OBSERVATION DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable an hourly change of a substance to be observed to be continuously observed while being able to observe an image having large magnification utilizing X-rays by thinning a supporting film to the extent not to interface with transmission of X-rays while forming a throughhole on a supporting member. CONSTITUTION: Photoelectric conversion film 42 is fixed to a supporting film 43 thin to the extent not to interfare with transmission of X-rays for being arranged inside a vacuum container 31 to perform photoelectric conversion without attenuating an expanded X-ray image in order to observe the converted image as a visible image. Thereby, observation of the enlarged image of a substance to be observed is made possible while making it possible to observe even a continuous hourly change. Further, since a throughhole 40 is formed on a supporting member 44, which supports the supporting film 43, a vacuum degree can be made equal between the side of X-ray imaging and the side of electron imaging while being able to make the supporting film 43 extremely thin.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)特 許 公 報 (B2)

(11)特許出願公告番号

# 特公平6-40476

(24)(44)公告日 平成6年(1994)5月25日

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>

識別記号

FΙ

H01J 37/22

G21K 7/00

9215-2G

H01J 31/50

A 8326-5E

請求項の数3 (全5頁)

(21)出願番号

特願昭63-172248

(22)出願日

昭和63年(1988)7月11日

(65)公開番号

特開平2-21550

(43)公開日

平成2年(1990)1月24日

(71)出願人 999999999

浜松ホトニクス株式会社

静岡県浜松市市野町1126番地の1

(72) 発明者 大須賀 慎二

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ

トニクス株式会社内

(72) 発明者 杉山 優

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ

トニクス株式会社内

(72)発明者 大庭 昌

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ

トニクス株式会社内

(74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)

審査官 飯高 勉

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 X線像観察装置

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】X線が入射する入射窓を備えた真空容器と、

前記入射窓からX線が照射される位置に、観察すべき試料を位置させる試料保持部材と、

前記入射窓から入射し前記試料を透過したX線を所定の 位置に結像させるX線結像手段と、

前記X線の結像位置に設けられた支持膜と、

この支持膜に付着形成された光電変換膜と、

この光電変換膜が前記 X 線の結像位置に配置されるよう 10 に前記支持膜を支持して前記真空容器に固定された支持 部材と、

前記光電変換膜からの電子を所定の位置に結像する電子 結像手段とを備え、

前記支持膜は前記X線の透過を妨げない程度に薄くなっ

2

ており、かつ前記支持部材には少なくとも1つの貫通穴が形成されていることを特徴とするX線像観察装置。

【請求項2】前記支持部材は前記真空容器中の前記電子 結像手段側に突出形成された筒体をなし、前記貫通穴は この筒体の側壁に形成されていることを特徴とする請求 項1記載のX線像観察装置。

【請求項3】前記真空容器はX線源を収容しており、このX線源と前記X線結合手段は前記入射窓によって仕切られていることを特徴とする請求項1記載のX線像観察装置。

## 【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

本発明はX線像観察装置に関し、特に詳細には、光電変換膜をその中に備えた真空容器を有するX線像観察装置に関する。

## 〔従来技術〕

従来、X線像観察装置では拡大されてきたX線像をX線フィルム上に投影し、そのX線フィルムを現像することにより拡大像を観察していた。また、特に微弱なX線像を観察するためには、X線の減衰を防止するために真空容器内で拡大して観察する必要がある。その為、X線フィルムは真空容器内に固定された状態で拡大像を撮影し、その後、真空容器を破壊して取り出して現像することにより拡大像を観察していた。

また、X線フィルムを使用せず、シンチレータを用いて 10 X線像を電子像に変換して、その電子像を蛍光面に写し 出すことにより像を観察する装置が、例えば特開昭59 -101134号公報に開示されている。

更にまた、測定物を真空容器のX線入射窓上に固定し、その対向面で真空容器の内面にX線-電子変換膜を付着し、測定物を透過したX線をX線-電子変換膜により電子に変換し、その電子像をフィルムに撮影する方法も知られている。

#### [発明の解決すべき問題点]

上記 X 線フィルムを使用する方法では、拡大像を観察す 20 るためには X 線フィルムを現象しなければならない。この為、観察すべき物体の時間的変化を観察することができず、またこの X 線フィルムを現像するためには真空容器を破壊し取り出さなければならなかった。 更に、この様な X 線フィルムを使用する方法では、 X 線フィルムに照射された X 線の量とそのフィルムの黒化度との関係の再現性が悪く、更に、その X 線の量と黒化度との直線性が悪いことにより、正確な拡大像を観察出来なかった。また、人間がその拡大像を目視するためには、その現像した X 線フィルムを拡大したり顕微鏡で観察したりしな 30 ければならず、拡大像の観察に繁雑な手間が掛かっていた。

一方、上記公報に開示されるシンチレータを使用する装置では、真空容器内でX線像を拡大していないため、微細なX線像を観察することが出来ず、また顕微鏡として使用できるほど拡大することも出来ない。

更に、真空容器のX線入射窓の内面にX線-電子変換膜を付着させる方法では、大気圧と真空容器内の圧力差による破壊を防止するため、このX線入射窓の厚さを一定以上にしなければならない。そのため、入射窓部におい 40 てX線が吸収されて減衰することによって、鮮明な像を得ることが難しくなっていた。

そこで、本発明は上記問題点を解決し、被観察物の時間 的変化を連続的に観察でき、かつ、X線を利用して拡大 率の大きい像を観察することの出来るX線像観察装置を 低することを目的とする。

## [問題点を解決するための手段]

本発明のX線像観察装置は、X線が入射する入射窓を備 されている。試料導入部2は試料室21に設けられた直えた真空容器と、この入射窓からX線が照射される位置 線導入端子22と、この直線導入端子22に固定されたに、観察すべき試料を位置させる試料保持部材と、この 50 試料セット部材23と、X線像拡大部3とを仕切るゲー

入射窓から入射し試料を透過したX線を所定の位置に結 像させるX線結像手段と、このX線の結像位置に設けら れた支持膜と、この支持膜に付着形成された光電変換膜 と、この光電変換膜がX線の結像位置に配置されるよう に支持膜を支持して真空容器に固定された支持部材と、 光電変換膜からの電子を所定の位置に結像する電子結像

光電変換膜からの電子を所定の位置に結像する電子結像 手段とを備えて構成する。そして、支持膜はX線の透過 を妨げない程度に薄くなっており、かつ支持部材には少 なくとも1つの貫通穴が形成されていることを特徴とす る。

ここで、支持部材は真空容器中の電子結像手段側に突出 形成された筒体をなし、貫通穴はこの筒体の側壁に形成 されていることを特徴としてもよい。また、X線源は上 記真空容器中に設けられていてもよい。

#### [作用]

本発明のX線像観察装置では、試料保持部材によって配置された試料に対して、入射窓からX線が照射される。この試料を透過したX線は、X線結像手段によって所定の位置に結像される。なおこの場合、拡大された像として結像させることが好ましい。

また、この結像位置に設けた光電変換膜によって、X線像が可視像に変換されるが、この際、光電変換膜を、X線の透過を妨げない程度に薄い支持膜に固定することで、このX線が多大に減衰されることなく光電変換される。

また、この支持膜は支持部材によって支持されるが、この支持部材に貫通穴を形成することで、支持部材を境としたX線結像側と電子結像側とで真空の程度が同等になるように作用する。

#### 〔実施例〕

以下添付図面の第1図および第2図を参照して、本発明の実施例を説明する。尚、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。第1図は実施例に係るX線像観察装置の全体構造図である。図示の通り実施例の装置は、X線を出射するためのX線源をなすX線出射部1と、試料をセッして導入するため試料導入部2と、X線像を拡大するためのX線像拡大部3と、電子像を拡大するための電子像拡大部4と、拡大像を観察するための拡大像観察部5とを備えている。そして、上記のX線出射部1、試料導入部2、X線像拡大部3および電子像拡大部4は真空容器100中に組み付けられている。

X線出射部1は真空室11に設けられた熱陰極12とX 線が入射する板状の入射窓に固定されたターゲット13 を含み、真空室11はこの入射窓によって、X線像拡大 部3側の真空室31と仕切られた構造となっている。な お、この真空室11はバルブ14を介して真空系に接続 されている。試料導入部2は試料室21に設けられた直 線導入端子22と、この直線導入端子22に固定された 試料セット部材23と、X線像拡大部3とを仕切るゲー

4

20

トバルブ24とを含み、試料セット部材23には試料2 5がセットされるようになっている。そして、試料室2 1はバルブ26を介して真空系に接続され、真空引きが 可能になっている。

X線像拡大部3は真空容器100により形成される真空 室31と、X線を反射させる斜入射反射鏡32と、不要 な X 線をカットする遮光板 3 3 とを有し、真空室 3 1 は バルブ34を介して真空系に接続されている。電子像拡 大部4は真空容器100により形成される真空室41 と、X線を受けて電子(光電子)を放出する光電変換膜 10 42と、光電変換膜42を支持する支持膜43と、支持 膜43を支持して真空容器100に固定される筒状の支 持部材44と、電子を増倍させるマイクロチャンネルプ レート45と、電子を受けて螢光を発する螢光膜46 と、電子増を拡大するコイル47、48とを有し、真空 室41はバルブ49を介して真空系に接続されている。 拡大像観察部5はリレーレンズ51と撮像管52を有 し、更に図示しないフレームメモリ、モニタなどを有し ている。

第2図は光電変換膜42の近傍の拡大構成を示してい る。図示の通り、X線像拡大部3の真空室31と電子像 拡大部4の真空室41は支持部材44によって仕切ら れ、この支持部材44の基端部は真空容器100の内面 に固定される。支持部材44の先端部は電子像拡大部4 側に突出する筒体をなし、その先端には支持膜43が固 定されてここに光電変換膜42が付着形成される。ここ で、支持膜43は微弱なX線を透過できる程度に十分に 薄く (数 μ m) かつその材料は X 線透過性を有するもの となっている。従って、矢印A方向にX線が入射される と矢印B方向に光電子が放出される。また、支持部材4 4の側壁には複数の貫通穴40が形成され、これによっ て真空室31と真空室41の真空の程度が同等になるよ うになっており、従って支持膜43を極めて薄くするこ とが可能になっている。

次に、上記実施例に係るX線像観察装置の作用を順次に 説明する。

まず、試料セットの際にはゲートバルブ24を図中の点 線のように閉じて試料室21の真空を解除する。この状 態では、直線導入端子22および試料セット部材23は 図中の実線のように試料室21に収容されており、図示 40 しない扉をあけて試料25を試料セット部材23にセッ トする。そして、扉を閉じてバルブ26を開き、試料室 21を真空引きする。試料室21が真空になったらゲー トバルブ24を図中の実線のように開き、直線導入端子 22を操作して試料セット部材23を観察位置まで送 る。これにより、試料25は所定の位置にセットされ

次に、熱陰極12に通電して熱電子をターゲット13に 向けて放出する。これにより、ターゲット13からはX 線が生成され、このX線は入射窓から試料25に向けて 50 上記実施例では斜入射X線反射鏡を用いてX線像を拡大

出射される。X線は試料25を透過して斜入射反射鏡3 2で反射され、従って光電変換膜42に拡大されたX線 像が形成される。ここで、不要なX線は遮光板33によ りカットされる。光電変換膜42にX線像が形成される と、これに対応して電子が放出される。これによる電子 像はコイル47、48を介して拡大され、マイクロチャ ンネルプレート45で電子増幅されて螢光膜46に結像 される。従って、螢光膜46では拡大された光学像が得 られることになる。

ここで、斜入射反射鏡32の拡大倍率を20倍とし、電 子像拡大部4の光電変換膜42上での分解能を1μmと し、コイル47、48で構成される電子レンズの拡大倍 率を100倍とすると、試料25上での分解能は1μm /20=50nmとなり、また螢光膜46上では試料25 上の50nmが0.1nmに拡大されることになる。

更に、螢光膜46上に形成された拡大像はリレーレンズ 51を通してTVカメラ(撮像管52)にその像が捕ら えられ、このTVカメラで捕らえられた拡大像は電気ビ デオ信号に変換されてビデオフレームメモリに送られ る。このビデオフレームメモリでは送られてきた電気ビ

デオ信号をA/D変換し、一定時間積算する。そして積 算された結果をモニタに送る。このモニタでは積算され た結果より可視像を作成する。このTVカメラで螢光膜 46上に形成された可視像を撮像することにより、モニ タ上では試料上での50mも容易に目視することができ る。すなわち、リレーレンズ51の倍率を1倍、TVカ メラ52の入力面の大きさを10m×10mmとし、モニ タの画面を20cm×20cmとすると、このX線顕微鏡で は全体として、20×100×20=40000倍の倍 率を得ることができる。

また、X線像が十分な強度を有している場合にはビデオ フレームメモリを用いること無く、TVカメラの一般的 な時間分解能である1/30秒毎に1枚の画像が得られるの で、ほぼリアルタイムのX線像の観察が可能となる。し かし、X線像が微弱な場合には、先に説明した実施例の ようにビデオフレームメモリを用いて電気ビデオ信号を A/D変換し、信号を積算することにより良好な画像を 得るようにする必要がある。この場合には、リアルタイ ムでの拡大像の観察を行うことは出来ないが、連続的な 観察は可能となる。

本発明は上記実施例に限定されるものではなく、種々の 変形が可能である。

例えば、光電変換膜42及び支持膜43の構成について は、ガラス、金属またはSi等の支持体44にSisN 。膜、有機薄膜等(パリレン等)を張り付け、その上に Auの薄膜を付着させればよい。またX線を電子に直線 変換することの出来るAuの薄膜の代わりにヨウ化セシ ウムとアンチモンセシウムとの2層構造体を用いて、X 線を間接的に光電子に変換してもよい。

しているが、本発明の装置にはX線ゾーンプレート又は 多層膜X線反射鏡を用いてX線像を拡大してもよい。また、入射X線強度が十分に高いときはマイクロチャンネルプレートを設けることは必須ではなく、更に蛍光膜46の位置にCCDデバイスを設けて画像情報を得るよううにしてもよい。更に、上記実施例では像を拡大する例について説明したが、等倍、すなわち拡大しない場合にも本発明は適用できる。

#### [発明の効果]

以上、詳細に説明した通り本発明では、X線を光電変換 10 して更に可視像として観察できるので、X線フィルムを 現像拡大するような繁雑な処理を必要とせずに拡大像を 得られ、更に被観察物としての試料の拡大像の連続的な 時間的変化をも、リアルタイムで観察することが可能と なる。

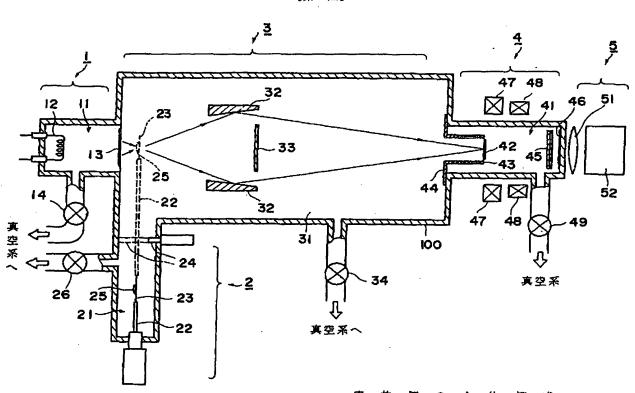
さらに、X線像を拡大したのち電子像に変換し、更にこの電子像を拡大して可視像とするため、非常に大きい拡大倍率を得ることができる。

また、X線像を最終的に電気信号に変換できるため、光電変換膜より放出された光電子に相当する電気信号を積算することにより、非常に微弱なX線像であっても、鮮明にその拡大像を得ることができる。

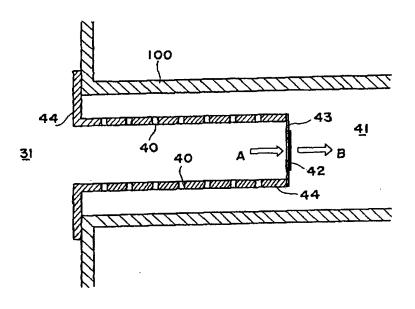
#### 【図面の簡単な説明】

第1図は、本発明に従う実施例の側面構成図、第2図は、第1図に示す光電膜近傍の拡大側面図である。
1……X線出射部、11……真空室、12……熱陰極、13……ターゲット、2……試料導入部、21……試料室、22……直線導入端子、23……試料セット部材、24……ゲートバルブ、25……試料、3……X線像拡大部、31……真空室、32……斜入射反射鏡、33……遮光板、4……電子像拡大部、41……真空室、42……光電変換膜、43……支持膜、44……支持部材、45……マイクロチャンネルプレート、46……螢光膜46、5……拡大像観察部、51……リレーレンズ、52……TVカメラ。

【第1図】



【第2図】



光電変換膜近傍の構成

## フロントページの続き

(72)発明者 木下 勝之 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ トニクス株式会社内

(56)参考文献 特開昭51-33554 (JP, A)